

191862-2026 - Konkurrencevilkår

Tyskland – Mikroelektroniske maskiner og apparater – Fully Automated Wafer Electro Chemical Metal Plating Tool (IZM-140) - PR1163163-3460-P

OJ S 55/2026 19/03/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Varer

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12

E-mail: einkauf@zv.fraunhofer.de

Køberens retlige status: Offentlig virksomhed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Fully Automated Wafer Electro Chemical Metal Plating Tool (IZM-140) - PR1163163-3460-P

Beskrivelse: Fully Automated Wafer Electro Chemical Metal Plating Tool (IZM-140)

Identifikator for proceduren: 210595d3-be30-4c2a-b1ed-0fc10c872274

Intern ID: PR1163163-3460-P

Udbudsprocedure: Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 31712100 Mikroelektroniske maskiner og apparater

2.1.2. Udførelsessted

By: Dresden-Moritzburg

Postnummer: 01468

Landsdel (NUTS): Meißen (DED2E)

Land: Tyskland

Yderligere oplysninger: Reinraum - tbd nach Zuschlagserteilung & Absprache mit Fhl

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

vgv -

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Bekendtgørelse, Udbudsdokument, Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret:

Korruption:

Deltagelse i en kriminel organisation:

Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning:
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet:
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme:
Svig:
Børnearbejde og andre former for menneskehandel:
Insolvens:
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område:
Aktiver, der administreres af en kurator:
Afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, eller indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure:
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren:
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure:
Alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:
Ophævelse eller en lignende sanktion:
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet:
Tilsidesættelse af forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger:
Erhvervsvirksomheden er indstillet:
Tilsidesættelse af forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter:
Terrorhandling eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet:
Tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til rent nationale udelukkelsesgrunde: Es gelten alle einschlägigen zwingenden wie fakultativen Ausschlussgründe, die durch nationales Recht normiert sind.

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0000

Titel: Fully Automated Wafer Electro Chemical Metal Plating Tool (IZM-140) - PR1163163-3460-P

Beskrivelse: 1 System: Fully Automated Wafer Electro Chemical Metal Plating Tool (IZM-140)
Die folgende Gerätespezifikation definiert ein vollautomatisches Werkzeug für die elektrochemische Abscheidung (ECD) verschiedener Metallschichten auf Wafer-Substraten. Der Schwerpunkt liegt auf Bumps mit hohem Aspektverhältnis, Redistribution Layers (RDL) und der Kupferfüllung von Silizium-Durchkontaktierungen (TSV) mit hohem Aspektverhältnis. Die Wafer-Substrate bestehen aus Silizium und/oder Glas, haben Durchmesser von 200 und 300 mm und eine Dicke von bis zu 2 mm. Vor dem Prozess werden die Wafer in Front Opening Unified Pods (FOUPs) zum Werkzeug transportiert, die vom Bediener manuell auf die jeweiligen Ladeöffnungen gesetzt werden. Das neue Werkzeug muss in der Lage sein, die folgenden Schritte vollautomatisch auszuführen: • Entladen der vorgesehenen Wafer aus dem FOUP • Durchführen der Nassprozesse • Entladen der Wafer zurück in ihre Ausgangsposition im FOUP Die Programmierung von Rezepturen muss innerhalb eines für Forschung und Entwicklung (F&E) erforderlichen angemessenen Bereichs von Optionen und Parametern möglich sein. Das mit der neuen ECD-Kammergeneration für galvanische Prozesse zu beschaffende System ermöglicht die flexible Metallabscheidung von Säulen mit hohem Aspektverhältnis, TSV (vollständige Füllung/Auskleidung), Damascene-RDL/Vias (z. B. für Hybridbonding) sowie hochdichte RDLs mit Linien-/Abstandsabständen von < 1 µm für 300-mm-BEOL-Prozesse, wobei die Handhabung die Verarbeitung von verdünnten und gebondeten Wafern und Glaswafern (2,5D/3D-Systeme) mit hoher Verformung und Wölbung ermöglicht. Das Werkzeug muss die Galvanisierung und Füllung von höheren Aspektverhältnissen und größeren Volumina ermöglichen. Die für diese neuen Anwendungen

erforderlichen Verbindungsmetalle sind Cu, Ni, SnAg, Au und optional In. Optionale Features:
- Ausgedünnter Wafer-Dickenbereich von 200 und 300 mm (Si oder Glas): 300 ... 600 µm (LV-Pos. 1.19.) - Maschine ist für Wafer-Flip vorbereitet (LV-Pos. 1.33.) - Roboter mit Kanten-Greifer-Endeffektor (LV-Pos. 1.34.) - Chemische Vorreinigung und Vorbefeuchtung mit deionisiertem Wasser für Resistmuster (LV-Pos. 2.21.) - Inline-Inspektion und Reinigung von versiegelten Ringkontakten (LV-Pos. 2.22.) - Indium-Muster-Galvanisierung (LV-Pos. 2.28.) - Einzelwafer-Sprühverfahren (LV-Pos. 2.31.) - 2 x Tanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils mindestens 10 Litern für verschiedene Vorreinigungsschemikalien (LV-Pos. 2.32.) - Rückgewinnungsmodus (LV-Pos. 2.33.) - Überlaufschutz (LV-Pos. 2.34.) - DI-Wasserreinigung (LV-Pos. 2.35.) - N2-Trocknung (LV-Pos. 2.36.) - Einzelwafer (LV-Pos. 2.82.) - Tankvolumen von ca. 50 Litern für Elektrolyt (LV-Pos. 2.83) - N2-Spülung (LV-Pos. 2.84.) - Tankheizung/Kühlung 20 °C bis 60 °C / +-2 °C (LV-Pos. 2.85.) - Überlaufschutz für Tank und Kammer (LV-Pos. 2.86.) - Inline-Filtergehäuse (LV-Pos. 2.87.) - Gleichstromversorgung / stufenweise einstellbar Ampere Auflösung / bis zu 50 Ampere (LV-Pos. 2.88.) - Lebensdauer des Kontakttrings > 20.000 Wafer / 2 mm Dichtungsposition / siehe Anhang (LV-Pos. 2.89.) - DI-Wasserspülung (LV-Pos. 2.90.) - Inertanoden (LV-Pos. 2.91.) - Kantenwulstentfernung einstellbar in einem Bereich von 2 mm bis 5 mm (LV-Pos. 2.108)
Intern ID: LOT-0000

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 31712100 Mikroelektroniske maskiner og apparater

5.1.2. Udførelsessted

By: Dresden-Moritzburg

Postnummer: 01468

Landsdel (NUTS): Meißen (DED2E)

Land: Tyskland

Yderligere oplysninger: Reinraum - tbd nach Zuschlagserteilung & Absprache mit Fhl

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 60 Døgn

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives: Ikke påkrævet

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): ja

Yderligere oplysninger: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Bekendtgørelse, Udbudsdokument

Kriterium: Referencer på specificerede arbejder

Beskrivelse af udvalgelseskriterium: Referenz von mindestens 10 Geräten / Projekten mit vergleichbarer technologi-scher Funktionalität im Elektro-Plating Bereich nicht älter als fünf Jahre (Kurzbeschreibung Gerät, Pflichtangabe 300mm Wafergröße ja/nein, Kundennennung).

Sollten Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen Ihre Kunden nicht benennen dürfen, so kategorisieren Sie bitte Ihren Auftraggeber (Forschung, Industrie, andere öffentliche Auftraggeber) und bestätigen Sie, dass Ihre Referenzen mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind. *** ACHTUNG *** Sollten Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen Ihre Ansprechpartner nicht benennen dürften, so kategorisieren Sie bitte Ihren Auftragsgeber (Forschung, Industrie, andere öffentliche Auftragsgeber) und bestätigen Sie, dass Ihre Referenzen mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind.

Kriterium: Gennemsnitlig årlig arbejdsstyrke

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Darstellung der Firma: Mindestangaben: Gründungsjahr, wichtige Meilensteine des Unternehmens, Anzahl der Mitarbeiter, was wird hergestellt / welche Leistungen werden erbracht -> Alle Angaben bitte in Textform; KEINE Links oder Bilder.

Kriterium: Andre økonomiske eller finansielle krav

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: 1. Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 123 und § 124 GWB 2. Eigenerklärung-Selfdeclaration (EU) Nr. 833/2014

Kriterium: Finansielt forhold

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre

Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser:

Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 3

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: tysk

Adresse på udbudsdokumenterne: https://vergabe.fraunhofer.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c6594c6a2-742fc357e6274b23

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for proceduren:

Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at afgive tilbud: 11/05/2026

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Tilladt

Indgivelsesadresse: <https://vergabe.fraunhofer.de>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: tysk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Tilladt

Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 20/04/2026 08:00:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet:

Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.

Yderligere oplysninger: Siehe Vergabeunterlagen

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet

beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Bei evtl. Einsatz von Nachunternehmern sind diese zu benennen, ihre Eignung ist ebenfalls anhand der unter "Ausschreibungsbedingungen" aufgeführten Eignungskriterien nachzuweisen. Ferner ist zu bestätigen, dass sie im

Auftragsfall zur Verfügung stehen; deren Anteil am Umfang des Auftragsgegenstandes ist darzulegen.

Elektronisk fakturering: Tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Vergabekammern des Bundes

Oplysninger om klagefrister: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, wenn der Zuschlag erfolgt ist, bevor die Vergabekammer den Auftraggeber über den Antrag auf Nachprüfung informiert hat (§§ 168 Abs. 2 Satz 1, 169 Abs. 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 15 Kalendertage nach Absendung der Bieterinformation nach § 134 Abs. 1 GWB. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße 10 Kalendertage nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB). Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB).

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsprocedurerne: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.

8. Organisationer

8.1. ORG-7001

Officielt navn: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12

Registreringsnummer: DE 129515865

Postadresse: Hansastrasse 27c

By: München

Postnummer: 80686

Landsdel (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Tyskland

Enhed: Einkauf Betrieb und Infrastruktur

E-mail: einkauf@zv.fraunhofer.de

Telefon: +49891205-0

Internetadresse: <https://vergabe.fraunhofer.de/>

Køberprofil: <https://vergabe.fraunhofer.de/NetServer/>

Denne organisations roller:

Køber

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

8.1. ORG-7004

Officielt navn: Vergabekammern des Bundes

Registreringsnummer: t:022894990

Postadresse: Kaiser-Friedrich-Straße 16

By: Bonn

Postnummer: 53113

Landsdel (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Tyskland

E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 228 9499-0

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-7005

Officielt navn: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.

Registreringsnummer: DE-129515865

Postadresse: Hansastrasse 27c

By: München

Postnummer: 80686

Landsdel (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Tyskland

E-mail: einkauf@zv.fraunhofer.de

Telefon: +49 89 1205-0

Internetadresse: <https://www.fraunhofer.de>

Denne organisations roller:

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-7006

Officielt navn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83

By: Bonn

Postnummer: 53119

Landsdel (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Tyskland

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Denne organisations roller:

TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: b4de9593-9422-4efd-885a-7eb6e2b207e9 - 01

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 16

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 18/03/2026 07:48:20 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Bekendtgørelsens officielle sprog: tysk, engelsk

Bekendtgørelsesnummer: 191862-2026

EUT-S-nummer: 55/2026

Offentliggørelsesdato: 19/03/2026